Otsuka 大塚電子

顕微分光膜厚計 OPTM series による 各種薄膜評価体験ワークショップ

日時：2025年11月5日（水）　10時～16時

＊各1回60分　開始時刻はそれぞれ10時～，11時15分～，13時15分～，14時30分～，15時45分～からお選びください。ご希望が重なった場合などは調整させていただきます。

場所：福井大学文京キャンパス 産学官連携本部II号棟3階会議室

内容：OPTMシリーズで持ち込んでいただいた試料をその場で測定いたします。
また、当日測定した結果はお持ち帰りいただけます。
※ご準備頂くサンプルにつきましては、別途御相談下さい。

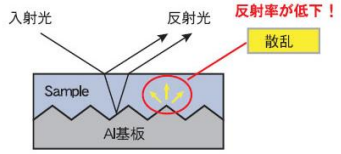
OPTM series 仕様

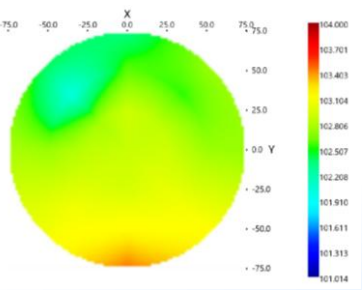
- 膜厚測定範囲1nm～35μm
- 最大200mm×200mm × 17mm(厚み)のサンプルに対応
- 自動ステージ仕様のマッピング機能で膜ムラを可視化
- 1ポイント直径10μmのスポットサイズ
- 薄膜でも高精度な光学定数解析
- 1ポイント1秒高速測定

OPTM series 測定事例

界面係数を用いたあれた基板上の膜厚

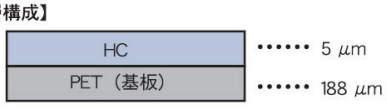
【層構成】





ハードコートの膜厚

【層構成】



ウェーハ上の25点の測定も1分以内に測定完了！

フィルム、光学材料、半導体材料、電子部品、自動車部品、DLCコーティング、医療器具など幅広い分野の材料に対応しています。測定事例も多岐に渡ります。

- さまざまな用途のDLCコーティング厚み
- 界面係数を用いたあれた基板上の膜厚
- 複数点同一解析を用いた n, k 未知の極薄膜
- 表面粗さを考慮した膜厚値
- 傾斜モデルを用いたITOの構造解析
- ハードコートの膜厚
- など他多数